

가용성 폴리이미드 표면을 이용한 광배향 TN-LCD의 전기광학 특성

박태규, 이정호, 서대식
 송실대학교 공과대학 전기공학과

EO Characteristics of photo-aligned TN-LCD on Soluble Polyimide Surface

Tae-Kyu Park, Jeong-Ho Lee, Dae-Shik Seo
 Dept. of Electrical Eng., Soongsil University

Abstract - The generation of pretilt in nematic liquid crystal (NLC) and electro-optical (EO) characteristics of photo-aligned twisted nematic (TN)-LCD with oblique p-polarized ultraviolet (UV) light irradiation on the two kinds of the soluble polyimide (PI) surfaces containing trifluoromethyl moieties were investigated. The generated pretilt angle of NLC is about 2.5° with p-polarized UV light irradiation of 20° on PI-3 surface at 20 min.; However pretilt angle of about 0.5° are observed on PI-1 and PI-2 surfaces. The generated pretilt angle of NLC on PI-3 surface may be attributed to the trifluoromethyl moieties attached to the lateral benzene rings. The voltage-transmittance and response time characteristics of photo-aligned TN-LCD with p-polarized UV light irradiation of 20° on PI-1 surface at 20 min were almost same in comparison with the rubbing-aligned TN-LCD. However, the high threshold voltage and slow response are observed on PI-3 surface. Also, the decay time τ_d of photo-aligned TN-LCD is attributed to the anchoring energy of NLC.

본 실험에서 사용한 3 종류 폴리머의 분자구조를 그림 1 에 나타내었다.

그림 1 에 나타낸 프리커서는 ITO 전극이 코팅된 유리 기판 위에 스핀 코팅법을 이용하여 균일하게 도포 한 후 핫 플레이트에서 80°C에서 10분간 열처리한 후 오븐에서 250°C에서 1시간 동안 열처리하여 폴리이미드막을 형성하였다. 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV 광을 경사 조사하는 방법을 그림 2 에 나타내었다. 광원은 1 kW 용량의 UV 램프를 사용하였으며 UV의 파장 영역이 365nm에서 가장 높은 흡수치를 가진다. UV 광 조사는 프리틸트각을 발생시키기 위하여 10~70°의 경사조사를 이용하였으며, 조사시간은 10~60분간 변화시켜 사용하였다. 그리고 광배향 처리된 셀의 특성을 비교하기 위하여 러빙 처리한 셀을 제작하였다. 러빙 처리에 사용한 러빙강도 RS (rubbing strength) 는 이전의 논문에서 보고하였다.¹⁻²⁾ 그리고 셀은 약 60μm의 두께로 하여 anti-parallel 구조로 제작하였다. 사용한 액정은 불소계열의 혼합형 네마틱 액정 (fluorinated type mixture; T_c=87°C) 으로 isotropic phase 로 주입 한 후, 97°C에서 10분간 열처리한 후 서냉 하였다. 또한 전기광학특성을 평가하기 위하여 직선 편광된 UV광을 20° 각도로 20분간 경사 조사하여 제작한 광배향 TN-LCD와 중간정도의 러빙강도로 제작한 러빙 처리한 TN-LCD를 5μm의 두께로 제작하였다. 네마틱 액정의 프리틸트각은 실온에서 결정회전법을 이용하여 측정하였다. 그리고 광배향 및 러빙 처리한 TN-LCD의 전기광학특성의 평가에는 전압-투과율(V-T) 특성 및 응답속도를 측정하였다

1. 서 론

LCD 소자에 있어서 고체 기판 위에 액정분자를 한쪽방향으로 균일하게 배열시키기 위한 방법인 액정배향처리하는 전기광학 특성을 향상시키기 위한 중요한 요소기술이다. 현재 액정배향처리법으로는 개발 초기부터 러빙천 등을 이용하여 고분자 표면을 문지르는 러빙처리법이 사용되어 왔다.¹⁻²⁾ 그러나, 이 러빙 처리법은 러빙천이 기판표면과 기계적으로 접촉하는 방식으로서 러빙시에 오물 및 정전기 등이 발생하여 TFT (thin-film-transistor) 소자를 파괴하는 등의 영향을 미치고 있다.³⁾ 이러한 문제점을 해결하기 위해서 기계적인 러빙처리를 하지 않는 너러빙 처리법(rubbingless method)이 강하게 요구되고 있다. 현재, 여러 종류의 너러빙처리법 중에서도 광배향처리법이 큰 기대를 모으고 있다.

최근, 폴리이미드 표면에 UV 광을 조사시의 액정배향 및 프리틸트각 발생에 관하여 여러 연구가 등에 의하여 보고되었다.³⁻⁸⁾ 그리고, 본 저자 등은 폴리이미드 표면에 UV 광을 경사 조사시의 액정배향, 프리틸트각의 발생 그리고 광배향 TN-LCD의 전기광학특성들에 관하여 보고하였다.⁶⁻⁸⁾ 본 연구에서는 CF₃기를 포함한 2 종류의 가용성 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV 광을 경사조사시의 네마틱 액정의 프리틸트각 발생과 광배향 TN-LCD의 전기광학특성 등에 관하여 검토하였다.

2. 본 론

2.1 실험

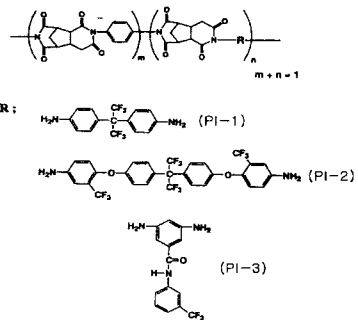


그림 1. 3 종류 폴리머의 분자구조.

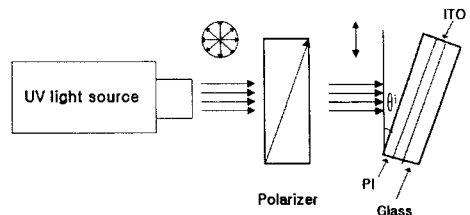


그림 2. 실험에 사용한 UV 광의 조사장치.

2.2 결과 및 고찰

그림 3 에 CF₃기를 포함한 3 종류의 가용성 폴리이미드 표면에서의 네마틱 액정의 프리틸트각의 러빙강도 의존성을 나타내었다. 네마틱 액정의 프리틸트각은 PI-3 막에 있어서 RS= 110 mm 일 때 약 16° 로 큰 값을 나타내었으며 러빙 강도가 증가함에 따라서 다소 감소하는 경향을 나타내었다. 이러한 네마틱 액정의 프리틸트각의 발생은 폴리머의 backbone 에 위치한 CF₃기의 역할에 기인 한 것으로 생각 할 수 있다. 그러나 PI-1 및 PI-2 막 에 있어서는 약 2° 정도의 작은 프리틸트각을 나타내었다. 본 저자 등은 이전의 논문에서 CF₃기를 포함한 4 종류의 가용성 폴리이미드 표면에 있어서의 네마틱 액정의 고 프리틸트각의 발생에 관하여 보고하였다.⁹⁾ 네마틱액정인 4-n-penty-4'-cyanobiphenyl (5CB)의 프리틸트각은 PI-3 막에 있어서 강한 러빙 영역에서 약 15° 정도의 프리틸트각을 발생하였으며 본 연구의 결과와 일치함을 알 수 있었다. 이러한 결과로부터 CF₃기를 함유한 가용성 폴리이미드 표면에서의 프리틸트각의 발생에는 액정분자와 폴리머 표면과의 배체체적 상호작용이 크게 기인 한 것으로 생각 할 수 있다.

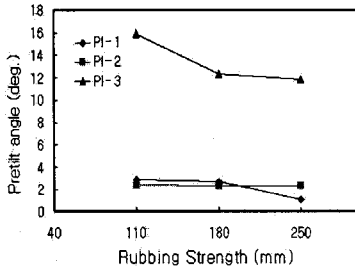


그림 3. CF₃기를 함유한 2 종류의 가용성 폴리이미드 표면에서의 네마틱 액정의 프리틸트각의 러빙강도 의존성.

그림 4 에 CF₃기를 함유한 3 종류의 가용성 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV 광을 20분간 경사 조사시의 프리틸트각의 입사각도 의존성을 나타내었다. PI-1 및 PI-2 막에서는 약 1° 미만의 작은 프리틸트각이 발생함을 알 수 있었다. 그러나 PI-3 막에서의 프리틸트각은 20° 의 입사각도에서 약 2.5° 가 발생하였으며 입사각도가 증가함에 따라서 현저하게 감소하는 경향을 나타내었다. 즉, 입사각도가 20° 에서 에너지가 가장 많이 입사되어 광분해 반응이 증가하여 프리틸트각 비교적 크게 발생하고, 입사각도가 증가함에 따라서 에너지가 감소되어 광분해 반응이 감소되어 프리틸트각이 감소하는 것으로 생각 할 수 있다. 그리고, PI-3 막에서는 러빙 처리한 셀에서와 같이 폴리머의 backbone 에 위치한 CF₃기의 기여로 인한 배체체적 상호작용에 기인한 것으로 생각 할 수 있다.

그림 5 에 CF₃기를 함유한 2 종류의 가용성 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV 광을 20° 로 경사 조사시의 프리틸트각의 조사시간 의존성을 나타내었다. 그림에서 보는 바와 같이, PI-1 막에서는 약 1° 미만의 작은 프리틸트각이 발생함을 알 수 있다. 그러나 PI-3 막에서의 프리틸트각의 발생은 조사시간이 20분에서 약 2.5° 의 값을 나타내었으며, 조사시간이 증가함에 따라서 현저하게 감소하는 경향을 나타내었다. 즉, 조사시간이 20분에서 가장 적당한 에너지가 입사되어 광분해 반응에 의하여 프리틸트각 발생하고, 조사시간이 증가함에 따라서 에너지가 증가하여 폴리머의 부분절단을 필요이상으로 진행시켜 프리틸트각이 감소하는 경향을 나타내는 것으로 생각 할 수 있다. 이러한 조사시간의 증가에 따라서 프리틸트각이 현저하게 감소하는 현상은 폴리머

의 분자구조에 따라서 차이가 있는 것으로 생각 할 수 있으며 이러한 경향은 소자특성에 좋지 않은 영향을 미칠 것으로 생각 된다.

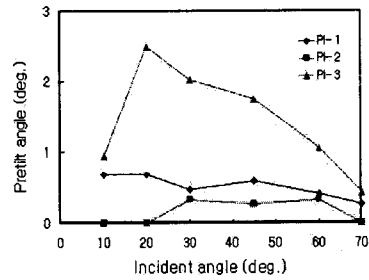


그림 4. CF₃기를 함유한 3 종류의 가용성 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV 광을 20분간 경사 조사시의 프리틸트각의 입사각도 의존성.

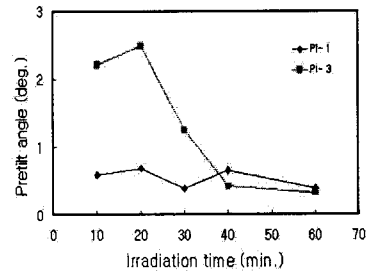


그림 5. CF₃기를 함유한 2 종류의 가용성 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV 광을 20° 로 경사 조사시의 프리틸트각의 조사시간 의존성.

그림 6 과 표 1 에 CF₃기를 함유한 가용성 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV 광을 20° 의 입사각도로 20분간 조사한 광배향 TN-LCD와 러빙 처리한 TN-LCD와의 V-T 특성을 나타내었다. 그림 6 에 나타낸 바와 같이 CF₃기를 함유한 PI-1 및 PI-3 막의 러빙 처리한 TN-LCD는 거의 유사한 특성을 나타내고 있음을 알 수 있다. 그리고 PI-1막을 이용한 광배향 TN-LCD는 PI-1 막을 러빙 처리한 TN-LCD보다 임계치 전압이 증가하는 경향을 나타내었다. 또한 PI-3 막을 이용한 광배향 TN-LCD 는 임계치 전압이 매우 증가하는 경향을 나타내었다. 즉, CF₃기를 함유한 가용성 폴리이미드 표면을 이용한 광배향 TN-LCD는 러빙 처리한 TN-LCD보다 임계치 전압이 높아짐을 알 수 있다. 본 저자들이 보고한 내용에 의하면, 측쇄기를 가진 폴리이미드 표면에 비 편광된 UV광을 경사 조사한 광배향 TN-LCD 가 러빙 처리한 TN-LCD보다 임계치 전압이 감소하는 경향을 나타내었다.⁶⁾ 이러한 결과로부터 광배향 TN-LCD의 전기광학특성에 폴리머의 분자구조가 많은 영향을 미치는 것을 알 수 있다.

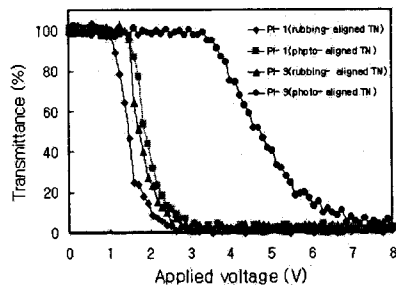


그림 6 CF₃기를 함유한 가용성 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV 광을 20°의 입사각도로 20분간 조사한 광배향 TN-LCD와 러빙처리한 TN-LCD와의 V-T 특성

표 1. CF₃기를 함유한 가용성 폴리이미드 표면에서의 광배향 TN-LCD와 러빙 처리한 TN-LCD의 인가전압에 따른 투과율.

	rubbing-aligned TN-LCD (PI-1)	photo-aligned TN-LCD (PI-1)	rubbing-aligned TN-LCD (PI-3)	photo-aligned TN-LCD (PI-3)
V ₉₀	1.1	1.5	1.6	3.7
V ₁₀	2.1	2.4	2.5	6.2

* V₉₀은 투과율이 90%일 때의 전압, V₁₀은 투과율 10%일 때의 전압

표 2에 CF₃기를 함유한 가용성 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV 광을 20°의 경사각도로 20분간 조사한 광배향 TN-LCD와 러빙 처리한 TN-LCD와의 응답속도를 나타내었다. PI-1 막에 있어서 광배향 TN-LCD가 러빙 처리한 TN-LCD 보다 하강시간 τ_d 가 증가하는 경향을 나타내었다. 이 결과는 본 저자 등이 보고한 내용과 잘 일치하고 있다.⁸⁾

표 2. CF₃기를 함유한 가용성 폴리이미드 표면을 이용한 광배향 TN-LCD와 러빙 처리한 TN-LCD의 응답속도.

	rubbing-aligned TN-LCD (PI-1)	photo-aligned TN-LCD (PI-1)	rubbing-aligned TN-LCD (PI-3)	photo-aligned TN-LCD (PI-3)
Rising Time (τ_r ms)	3.8	7.2	8.2	29.6
Decay Time (τ_d ms)	30.0	46.4	33.2	32.4
Response Time (ms)	33.8	53.6	41.4	62.0

응답속도에서 상승시간 τ_r 은 전기적인 에너지의 영향이, 하강시간 τ_d 는 탄성 에너지가 크게 기여하는 것으로 알려져 있다.

본 저자 등은 이전의 논문에서 측쇄기를 가지지 않는 폴리이미드 표면을 매우 약하게 러빙 처리한 경우 네마틱액정의 극각 방향의 결합에너지가 약 1×10^{-3} (J/m²) 이상인 것을 보고하였다.¹⁰⁾ 그리고 M.Hasegawa 등에 의하면 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV광을 조사한 경우 면내 방향의 결합에너지는 1×10^{-4} (J/m²) 정도로 보고하고 있다.¹¹⁾ 이러한 결과로부터, 폴리이미드 표면에서의 결합에너지는 러빙 처리한 셀 보다 광배향 셀 쪽이 작은 것으로 생각 할 수 있다. 따라서, 광배향 TN-LCD의 하강시간이 증가하는 것은 극각 방향의 결합에너지가 작기 때문인 것으로 생각 할 수 있다. 그리고 PI-3 막에 있어서 광배향 TN-LCD가 러빙 처리한 TN-LCD보다 응답속도가 매우 증가하는 경향을 나타내었다. 특히, 광배향 TN-LCD의 상승시간 τ_r 이 약 30ms로 매우 느린 응답속도를 나타내고 있다. 이 결과는 그림 6의 V-T 특성에서 임계치 전압이 증가하는 결과와 같은 맥락으로 생각 할 수 있다. 즉, 광배향 TN-LCD의 상승시간이 증가하는 것은 임계치 전압이 증가하기 때문인 것으로 생각 할 수 있다. 이러한 결과로부터 가용성 폴리이미드 표면을 이용한 광배향 TN-LCD의 응답특성에 폴리머의 분자구조가 매우 큰 영향을 미치는 것을 알 수 있다.

3. 결 론

본 연구에서는 CF₃기를 함유한 가용성 폴리이미드 표면에 직선 편광된 UV 광을 경사 조사시의 네마틱 액정의 프리틸트각의 발생 및 광배향 TN-LCD의 전기광학 특성에 관하여 검토하였다. 폴리머의 backbone에 CF₃기를 함유한 PI-3 표면에 직선 편광된 UV 광을

20°의 입사각도로 20분간 조사시의 네마틱 액정의 프리틸트각은 약 2.5°로 가장 크게 발생하였다. 그러나, PI-1 및 PI-2 표면에서는 모든 입사각도에서 약 0.5°의 작은 프리틸트각 얻어짐을 알 수 있었다. 또한, CF₃기를 함유한 가용성 PI-1막을 이용한 광배향 TN-LCD는 러빙 처리한 TN-LCD와 거의 유사한 임계치 특성 및 응답특성을 나타내었다. 그러나 폴리머의 backbone에 CF₃기를 가진 가용성 PI-3 표면을 이용한 광배향 TN-LCD는 러빙 처리한 TN-LCD보다 임계치 전압이 높고, 응답속도가 느린 경향을 나타내었다. 마지막으로, 광배향 TN-LCD의 하강시간 τ_d 는 기판 표면에서의 네마틱 액정의 극각 방향의 결합에너지의 기여가 큰 것으로 생각 할 수 있었다

(참 고 문 헌)

- [1] D.-S. Seo, K. Muroi, and S. Kobayashi, "Generation of pretilt angles in nematic liquid crystal, 5CB, media aligned on polyimide films prepared by spin-coating and LB techniques : effect of Rubbing", Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 213, 223, 1992.
- [2] D.-S. Seo, S. Kobayashi, and M. Nishikawa, "Study of the pretilt angle for 5CB on rubbed polyimide films containing trifluoromethyl moiety and analysis of the surface atomic concentration of F/C(%) with an electron spectroscopie for chemical analysis", Appl. Phys. Lett., Vol. 61, 2392, 1992.
- [3] H. Matsuda, D.-S. Seo, N. Yoshida, K. Fujibayashi, and S. Kobayashi, "Estimation of the static electricity and optical retardation produced by the rubbing polyimide and polyamide films with different fabrics", Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol. 264, 23, 1995.
- [4] T. Yamamoto, M. Hasegawa, and H. Hatoh, "Liquid-crystal alignment by slantwise irradiation of non-polarized UV light on a polyimide layer" SID digest paper, 642, 1996.
- [5] X. Wang and J.L. West, "The mechanism of pretilt generation on polarized ultraviolet light aligned polyimide film", SID digest paper, 5, 1997.
- [6] D.-S. Seo, L.-Y. Hwang, and S. Kobayashi, "Investigation of pretilt angle generation in nematic liquid crystal with slanted non-polarized ultraviolet light irradiation on polyimide surfaces", Liquid Crystals, Vol. 23, 923, 1997.
- [7] D.-S. Seo, J.-H. Lee, and C.-H. Lee, "Pretilt angle generation and EO performance in NLC with polarized UV light irradiation on polyimide surface", J. of KIEEME, Vol. 11, No. 10, 1998.
- [8] D.-S. Seo, J.-M. Han, and D.-S. Park, "Pretilt angle generation of NLC and EO performance of photo-aligned TN-LCD using obliquid non-polarized UV light irradiation on polymer surface", J. of KIEEME, Vol. 11, No. 10, 1998.
- [9] D.-S. Seo, M. Nishikawa, and S. Kobayashi, "Generation of high pretilt angles of nematic liquid crystal (5CB) on rubbed organic solvent soluble polyimide surfaces with helical backbone structure and trifluoromethyl moieties", Liquid Crystals, Vol. 22, No. 4, 515, 1997.
- [10] D.-S. Seo, Y. Iimura, and S. Kobayashi, "Temperature dependence of the polar anchoring strength of weakly rubbed polyimide films for the nematic liquid crystal (5CB)", Appl. Phys. Lett., Vol. 61, No. 2, 234, 1992.
- [11] M. Hasegawa and Y. Taira, "Determination of a photoalignment mechanism from the effects of linearly polarized deep uv on several polymers", 17th International Liquid Crystal Conference (July 19-24, 1998, in Strasbourg, France), P4-11, p-214, 1998.